

Fest-Kolloquium Optik 2003

„optics and optoelectronics: state of the art and future development“

Optik und Optoelektronik: Stand und zukünftige Entwicklung

mit Abschiedsvorlesung von Herrn Prof. Dr. H.J. Tiziani und

Antrittsvorlesung von Herrn Prof. Dr. W. Osten

am 19. Februar 2003, Teilnehmer: ca. 400

Begrüßung und Einführung	Prof. Dr. W. Osten ITO, Universität Stuttgart Prof. Dr. R. Gadow Fakultät für Maschinenbau, Universität Stuttgart Prof. Dr. H.J. Tiziani ITO, Universität Stuttgart
Grundlagenforschung an Halbleiter-Nanostrukturen	Prof. Dr. K. von Klitzing Nobelpreisträger Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart
Entwicklung der optischen Systeme für die Mikrolithographie	Dipl.-Pfys. Winfried Kaiser Carl Zeiss, 73446 Oberkochen
Moderne Optiksysteeme für die 3D-Vermessungstechnik	Dr. B. Braunecker Leica Geosystems, 9435 Heerbrugg; CH
Satelliten-Kommunikation mit Laserlicht	Dr. Z. Sodnik esa, ESTEC, Keplerlaan 1, 2200AG Noordwijk ZH, NL
Eröffnung der Festveranstaltung	Prof. Dr. D. Fritsch Rektor der Universität Stuttgart
Der Innovationsprozess bei Carl Zeiss	Dr. A. Siegel Carl Zeiss, 73446 Oberkochen
Laudatio für Herrn Prof. Tiziani	Prof. Dr. W. Karthe Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik, 07745 Jena
Faszinierende Optik und optische Messtechnik, Rückblick und Ausblick	Prof. Dr. H.J. Tiziani ITO, Universität Stuttgart
Optische 3D-Messtechnik: von der Idee zum System	Prof. Dr. W. Osten ITO, Universität Stuttgart

Optik-Kolloquium 2004

„optical production measurement technology - challenges and future directions“

Optische Fertigungsmesstechnik – Herausforderungen und Perspektiven

am 18. Februar 2004, Teilnehmer: ca. 300

Begrüßung und Einführung	Prof. Dr. W. Osten ITO, Universität Stuttgart
Prozessfähigkeit durch optische Messtechnik- Herausforderungen und Chancen	Prof. Dr.-Ing. T. Pfeifer Dipl.-Wirt.-Ing. K. Schneefuß Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik, IPT Aachen
Vergleichbarkeit optisch und taktil gemessener Gestaltabweichungen	Dr. P. Lehmann Mahr GmbH, Göttingen
Optische Messtechnik in den Mikro- und Nanotechnologien	Prof. Dr. G. Wilkening Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig
Hochauflösende interferometrische Messtechnik in der Fotolithografie	Dr. B. Dörband Carl Zeiss SMT AG, Oberkochen
Laserinterferometrische Mess- und Sensortechnik in der Fertigung	Prof. Dr.-Ing. G. Jäger TU Illmenau, Illmenau
Optische Messtechnik in der modernen Gleitsichtglasfertigung	F. Gruna Rodenstock, Messtechnik Brillenoptik, München
Informationstheoretische Optimierung von 3D-Sensoren- oder : Wieviel darf ein Sensor kosten?	Prof. Dr. G. Häusler Universität Erlangen und 3D-SHAPE GmbH, Erlangen
Das Prinzip der Phasogrammetrie- flexible automatisierte Erfassung komplexer Objektgeometrien	Dr. G. Notri Fraunhofer-Institut für angewandte Optik und Feinmechanik IOF, Jena
Stiefenprojektionen in der Fertigungsmesstechnik am Beispiel präzisionsgeschmiedeter Zahnräder	Prof. Dr. -Ing. E. Reithmeier Dr.-Ing. J. Seewig TU Hannover, IMR Hannover
Anwendung optischer Messtechniken im Flugzeugbau	Dr. U. Schnars, R. Henrich, D. Scherling A. Kück, Dr.-Ing. S. Seebacher Airbus Deutschland GmbH, Bremen
Anwendung optischer Messtechniken in der Automobilindustrie	Dr.-Ing H. Steinbichler Steinbichler Optotechnik GmbH, Neubeuren
Diagnostik von Turbomaschinen mit optischen Messtechniken	Prof. Dr. J. Woisetschläger Technische Universität Graz, Österreich
Physikalisch-optische Effekte in der optischen CD-Metrologie	N. Kerwien, Prof. Dr. W. Osten ITO, Universität Stuttgart
Neue Ansätze bei tiefenscannenden Verfahren in der dimensionellen Messtechnik	Dr.-Ing. K. Körner, Prof. Dr. W. Osten ITO, Universität Stuttgart

Organized International Conferences: 2002 – 2004

W. Osten:

Interferometry XI. SPIE Congress,
10 – 11 July 2002, Seattle, USA

W. Osten:

**Optical Measurement Systems for Industrial
Inspection III, SPIE Congress,**
23 – 26 June 2003, Munich, Germany

W. Osten:

**Optical Metrology in Production Engineering.
SPIE Congress Photonics Europe,**
27 – 30 April 2004, Strasbourg, France

W. Osten:

Interferometry XII: Applications. SPIE Congress,
4 – 5 August 2004, Denver, USA

W. Osten:

**Optical Nondestructive Testing
ICEM 12, International Conference on
Experimental Mechanics**
31. August 2004, Bari, Italy

Impressum:

Publisher: Institut für Technische Optik (ITO)
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 9
D - 70569 Stuttgart
www.uni-stuttgart.de/ito

Editor: Dipl.-Ing. (FH) Erich Steinbeißer..... steinbeisser@ito.uni-stuttgart.de
Dipl.-Des. Matthias Staufer, ma•ma design (Graphic & Layout)..... mail@mamadesign.net

Printing: f.u.t. müllerbader gmbh

Print run: 400

ISBN 3-923560-52-4

